



인산 양극 산화 피막

- 본딩 밀착성을 향상 시키기 위해 적용되는 공정.

공정승인 현황

P4TF14

설비 현황

1,500 X 1,200 X 1,200 (mm)



명문장수기업
Time-honored Business

SAMWOO METAL Industries

[인산 양극 산화 피막의 특성]

- (1) Adhesive Bonding 성능 향상을 위한 공정
- (2) $3\mu\text{m}$ 의 피막 두께로 얇음.



공정도

수입검사 > 탈지 > 수세 > 산세 > 수세 > 인산 양극산화피막 > 수세 건조 > 포장 및 검사 > 출하